# 平成10、11年度整備アンジュレータビームライン

財団法人高輝度光科学研究センター 放射光研究所 後藤 俊治、高橋 直、桜井 吉晴、竹下 邦和 大橋 治彦、山崎 裕史、望月 哲朗、宇留賀朋也 大端 通、松下 智裕、山片 正明、矢橋 牧名 大石 泰生、木村 洋昭、Alfred Q. R. Baron、 八木 直人、鈴木 拓、井上 勝晶 日本原子力研究所 関西研究所

理化学研究所・播磨研究所

原 御、田中 良和、石川 哲也、北村 英男

1.はじめに

平成10、11年度の二ヵ年度で高エネルギー分解能 非弾性散乱ビームライン(BL35XU)、および、高 輝度ビームライン(BL40XU)2本の共用アンジュ レータビームラインの整備が進められている<sup>[1]</sup>。 いずれのビームラインも、要求される性能をこれま での標準的なアンジュレータビームラインではまか なうことができず、既存のコンポーネント、要素技 術をそのまま用いることができる部分と、新規に設 計が必要なものが混在することとなった。このなか で、高輝度ビームラインの方が比較的仕様をまとめ 上げるのが容易であり、平成10年度整備偏向電磁石 ビームライン4本に引き続いて平成10年の8月ごろま でに仕様が確定し、発注作業が進められた。一方、 高エネルギー分解能非弾性散乱ビームラインは、高 エネルギー分解能を得るための背面反射分光器と背 面反射アナライザーを実験ホール内の許されるスペ ースを無駄なく使い、パフォーマンスを最適にする ための検討に幾分時間が必要で、平成10年度末ぎり ぎりまで仕様確定と発注作業がもつれ込んだ。

以下では、前号の平成10年度整備偏向電磁石ビー ムライン<sup>[2]</sup>に引き続いて、これら2本のアンジュレ ータビームラインに関して、各要素毎に基本的な仕 様および現在の進捗状況等について報告する。

	BL35XU	BL40XU
挿入光源タイプ	標準型真空封止	真空封止
	アンジュレータ	ヘリカルアンジュレータ
磁石列タイプ	ピュアマグネット	ピュアマグネット
周期長	32mm	36mm
周期数	140	125
最小ギャップ	8mm	7mm
最大K值	$K_y = 2.4$	$K_x = K_y = 1.1$
磁石	NEOMAX-35EH	NEOMAX-35EH
	(NdFeB系)	(NdFeB系)

表1 挿入光源の主なパラメーター

2. 各ビームラインの仕様・構成

2-1.挿入光源

BL35XUおよびBL40XUの挿入光源の主なパラメ ーターを表1に示す。いずれも真空封止型アンジュ レータで、制御システム、形状変換部、真空システ ム、ビーム位置モニター、放射光インターロック等 の周辺機器は、従来の真空封止アンジュレータと同 じで大きな変更点はない<sup>[3-5]</sup>。

BL40XUは結晶分光器を置かずに、アンジュレー タの一次光のスペクトルをそのまま利用する高フラ ックスビームラインであるため、挿入光源はフラッ クスが大きいヘリカル型(位相は固定)を採用した。 得られるフラックスの計算例を図1に示す。磁石形 状は、中心付近でのピーク磁場の大きさと一様性の 向上、およびギャップ変化に伴う円偏光度の劣化を 抑えるために、図2のような形状とした。中央の磁 石列が垂直方向磁場を、左右のサイド列が水平方向 磁場を形成する。また、ビームインピーダンスを低 減させるため、中央の溝の部分はNiメッキしたCu のスペーサーで埋め、その上からCuメッキのNiシ ートで覆う。

BL35XU、BL40XUともに挿入光源の蓄積リング への設置は、1999年夏期停止期間中におこなわれる。

2-2.フロントエンド

(1) フロントエンドの構成・仕様

BL35XUのフロントエンドは、SPring-8で最も一 般的な標準真空封止型アンジュレータ対応の機器構 成・仕様となっており、既にこのタイプのフロント



ム電流100mA時のフラックス 実線:水平50µrad、垂直50µradのスリットを通し

て得られるフラックス、点線:全フラックス

エンドは8本(BL09XU、10XU、11XU、29XU、 39XU、41XU、44XU、47XU)分建設済みで、順 調に稼動している。図3に標準真空封止型アンジュ レータ対応のフロントエンド機器配置を示す。この 標準的なフロントエンドにおいて、放射パワーを処 理しながらビームサイズ成形に寄与する機器は、

- (a)固定マスク :1段、固定式で7mm角(全幅 で333μrad角)に成形、
- (b)前置スリット:可動式で直径4mm(直径154 μrad)に成形、
- (c)XYスリット : 可動式でフロントエンド出口 のビームサイズを可変に成形、

となっている。

図4にBL40XUのフロントエンド機器配置を示す が、標準型に比べて特殊な機器配置となっている。 光源がヘリカルアンジュレータであるこのビームラ インは、光学系において分光器を使わずに軸上近傍 の一次光だけ使用するとの方針に至ったことから、 当初10µrad程度で固定した放射光をフロントエン ドから取り出すことを求められた。しかしながら、 これではフロントエンド出口でのビームサイズが約 0.4mmにしかならず、コミッショニングにおける軸 出し作業などが非常に困難になるものと予想される ため、マスクで50µrad程度にカットし、後は必要 に応じてXYスリットで成形する方針とした。この 結果、マスクでほとんどのパワーを吸収(全放射パ ワー4.6kWに対し約4.5kW @K=1.2、100mA運転時) しなければならないため、マスクを前段と後段に分 けて放射パワーを処理する設計とした。光源から約

(1)A列



(2)B列



図2 BL40XU真空封止ヘリカルアンジュレータ磁石形 状<sup>[6]</sup>

(1) A列:水平方向磁場、(2) B列:垂直方向磁場。い ずれもビームは図の上方を紙面垂直方向に通過する

## - PUBLIC BEAMLINE-



図4 フロントエンド機器配置図(BL40XU)

22.4m離れた位置にある前段マスクで直径7mm (312.5µrad)に、前段マスクから約1m下流にある 後段マスクで直径1mm(42.7µrad)に絞る。前段、 後段ともマスク出口径は固定になっているが、当然 アライメントの軸と実際の光軸との間にはズレがあ り、コミッショニング時に直径1mmの出口を光軸 に合わせる必要があるため、後段マスクのみXYス テージに搭載し可動式としている。また、後段マス クは、XYスリットで成形せずに使用する場合を想 定して、XYスリットと同様にダブルスリット構造 としており、受光部の母材であるGlidCopで直径1.1 mmに、ヘビーメタルで直径1mmに出口径を絞って いる。これは、ワイヤカットによるGlidCopの加工 に比べて機械加工によるヘビーメタルの加工のほう が精度が上げられること、受光時の熱膨張による開 ロサイズの変化をできるだけ少なくできることによ る。マスクを抜けてくるパワーがごくわずかなもの になったため、前置スリットを設置する必要が無く なり、かつXYスリットも標準型のものよりかなり コンパクトなサイズになった。コミッショニング時 には、光電子モニターを用いて後段マスクとXYス リットの中心を光軸に合わせる。その他の光位置モ ニター、真空保護や放射線防御に関わる機器の構 成・仕様は、BL35XU同様に、従来の硬X線アンジ ュレータ用フロントエンドと同じである。

また、BL40XUはフロントエンド専用冷却系に新 規接続される最初のビームラインとなる。現在フロ ントエンドの冷却水はL1系と呼ばれる蓄積リング の電磁石、真空と共通の冷却システムから供給され ているが、計画当初時に比べて光源のパワーアップ 化が非常に進んだことなどから、L1系の冷却水の 絶対量が不足する事態に陥ってしまい、今後2年間 に渡ってフロントエンド専用の冷却系を新設するも のである。平成11年の夏にA、Dブロックを、平成 12年の夏にB、Cブロックを完成させるため、 BL35XUについては来年の夏までは既存のL1系に接 続される。FE専用冷却系では所定の最大流量(標 準的な挿入光源用フロントエンドで170L/min)が 流れる場合でも取り合いバルブ位置でIN側とOUT 側の圧力差が5kgf/cm<sup>2</sup>以上確保できる仕様になっ ている。また、取り合いバルブ~フロントエンド各 機器間の配管部分の圧力損失をできるだけ小さくす るために、取り合いバルブサイズを従来の25Aから 65Aに、また、フロントエンドの母配管サイズも 25Aから32Aに変更し、その間も徐々に絞っていく 配管径としている。フロントエンド専用冷却系の詳 細については、近々に「SPring-8利用者情報」でも 紹介する予定である。

(2)建設・整備状況

この2本のフロントエンドの本格的な建設は平成 11年度夏期運転停止期間(1999年7月3日~1999年9 月5日)におこなわれるが、5月の連休ごろ(第5サ イクルと第6サイクルの間の運転停止期間)から工 事は開始されている。既に、架台や共通レールの搬 入、収納部天井の通線用コア抜き等の作業は終了し ており、さらにサイクル間の停止期間を利用して共 通レールの精密アライメントも順次実施中である。

2-3.放射線遮蔽ハッチ

図5、6にそれぞれのビームラインについて輸送 系・光学系と合わせて放射線遮蔽ハッチの全体図を 示す。ハッチ設計における基本的な原則、一般事項 は偏向電磁石ビームラインの場合<sup>[2]</sup>とかわること はない。表2にBL35XUおよびBL40XUのハッチの 基本仕様を示す。

BL35XUの実験八ッチは、上流側から実験八ッチ 1、2、4、3と呼ぶことにしている。これは、主とし て用いられる実験モードにおいて、実験八ッチ3の 終端部に設置された背面反射分光器によって高エネ ルギー分解能化された単色光が実験ハッチ4に戻っ てくる格好で導入されるためである。実験ハッチ3 に光学ハッチにおいて単色化された放射光を導入し ながら実験ハッチ4内にアクセスすることを可能と するため実験ハッチ4にはシールドパイプが設置さ れている。このように実験ハッチ4には、高エネル ギー分解能化され高次光を含まない放射光しか導入 されないため照射線量は他のハッチに比べて極端に 少ない。このため、遮蔽体としての鉛は必要なく、 鉄10mm厚のハッチパネルによって構成される。

背面反射型分光器を極力光源から遠ざけながら も、実験ホール内の外周側のエクスパンションジョ イントから1m以上実験ハッチを離して最低限の通 路を確保するために、実験ハッチ3の下流側は切り 欠かれた構造となっている。実験ハッチ4の複雑な 構造は、同様に実験ホール内の通路の確保と大型回 折計の収納の両立を図った結果である。

BL40XUのハッチは隣り合うBL40B2と一体化し 設計、施工したためBL40XUの光学ハッチと実験ハ ッチの一部の収納壁側側面はBL40B2光学ハッチと の共通壁とすることができた。これは前回報告した ような、既設ハッチの裏側の狭 いスペースにフロントエンド遮 蔽体を設置する困難さを避ける ための有用な方法であった。

2-4.輸送チャンネル・光学系

(1)輸送チャンネル・光学系の概要

(a) BL35XU

図5および図8に輸送系・光学 系の構成を示す。先に述べたよ うに、このビームラインは光学 ハッチと四つの実験ハッチから 構成される。光学ハッチ内の構 成される。光学ハッチ内の構 成は基本的に標準アンジュレー タ用のである。ただし、二 結晶でなく、液体窒素冷却が予 定ったいるほか、ビームパイ プのスペースは必要に応じて、 コリメーター、集光レンズ、強 度画されている。実験ハッチ1 以降の光学系については後の実

験ステーションにおいてまとめて述べることにする が、いくつかの実験モードを可能とするために実験 ハッチ4には最終段の実験ハッチ3の背面反射結晶分 光器へとビームを導くシールドパイプ(鉛厚さ 1mm)や、高低差370mmの2段のビームに対して実 験ハッチ1と2の間にて遮断するための二段下流シャ ッタなどが特別に導入されることになる。実験モー ドについては2-5、3-1も合わせて参照されたい。



表2 BL35XU, 40XUハッチの仕様

光学ハッチ長さ(内寸)

光学ハッチ高さ(内寸)

実験ハッチ1長さ(内寸)

実験ハッチ1高さ(内寸)

実験ハッチ2長さ(内寸)

実験ハッチ2高さ(内寸)

実験ハッチ4長さ(内寸)

実験ハッチ4高さ(内寸)

実験ハッチ3長さ(内寸)

実験ハッチ3高さ(内寸)

光学ハッチ天井部鉛遮蔽厚

光学ハッチ側面部鉛遮蔽厚

光学ハッチ前後面部鉛遮蔽厚

実験ハッチ1、2、3天井部鉛遮蔽厚

実験ハッチ1、2、3側面部鉛遮蔽厚

実験ハッチ1、2、3後面部鉛遮蔽厚

実験ハッチ3幅(内寸)

実験ハッチ4鉛遮蔽厚

実験ハッチ4幅(内寸)

実験ハッチ2幅(内寸)

実験ハッチ1幅(内寸)

光学ハッチ幅(内寸)

BL35XU

上流側2.54m

下流側4.12m

上流側4.12m

下流側4.77m

11m

3.3m

4.5m

3.3m

3.5m

3.0m

3.3m

20m

12m

3.3m

15mm

15mm

20mm

3mm

3mm

8mm

0mm

図5参照

図5参照

3.0m及び2.5m

BL40XU

上流側2.0m

下流側3.2m

上流側3.2m

下流側3.4m

11m

3.3m

3.3m

-

-

-

-

-

-

15mm

15mm

20mm

3mm

3mm

8mm

6m

#### (b) BL40XU

図6に輸送系・光学系の構成を示す。このビーム ラインでは結晶分光器を用いず、Kirkpatric-Baez 配置の集光ミラー系により二次元に集光される。初 段に水平偏向ミラーが置かれ視射角3mrad、偏向角 6mradにて実験ホール側に曲げられた後、後段の垂 直偏向ミラーにより視射角4mrad、偏向角8mradに て下方に偏向される。ミラーのコーティングは両方 ともRhで最大20keV程度までの放射光が利用でき る。その他のコンポーネントは標準型もしくはそれ に準拠したものが用いられる。スリット、Be窓等 は偏向電磁石ビームライン用と同等の熱負荷対策を したものであり、また、下流シャッタについても遮 蔽ブロックの上流側に水冷銅アブソーバを付加した ものを新規に設計した。

輸送チャンネル各コンポーネントの設計・製作は 順調に進められ、機器据え付けについては1999年8 月ごろから順次開始されていく予定である。

(2)分光器

BL35XUは光学ハッチまでに限ってみれば標準的 なアンジュレータビームラインであり、分光器の位 置での熱負荷は最大300~400W/mm<sup>2</sup>になると想定 される。分光結晶には標準的なシリコンの111反射 を使用するが、その冷却方式は、従来の水冷ピンポ スト方式に代わって、液体窒素冷却が採用される。 液体窒素による冷却には、直接冷却と間接冷却が検 討されており、現在進められているビームラインで の評価試験により決定することになる。



図6 BL40XUの放射線遮蔽ハッチおよび輸送系・光学 系 駆動機構はアンジュレータ対応の標準型を現在製 作中であり、各軸の分解能等は従来品と同等で十分 な性能を有している。対応するブラッグ角は3~ 27°で、全範囲にわたって定位置出射が可能である。 今回から各軸すべてに正確な指標が取りつけられる ことになり、指標に合わせるだけで立ち上げ前に必 要な調整ができるようになる。また、分光器の設置 誤差等を含む光軸のずれを補正するために、手動で 真空チャンバーごと上下左右に移動できる機構も付 加される。

#### (3) ミラーおよびミラー調整機構

図5に示されるように、BL35XUのミラーチャン バーには、ビームを下流に素通りさせるためミラー 本体表面から370mm下にビームダクトが設置され、 これを通してミラーの下流に設置された背面反射結 晶にビームが導かれる。光源方向に反射された光は ー旦シリコンの非対称反射により370mm上にはね あげられ、ミラーにより二次元集光される。ミラー 形状はサジタル円筒面の母材をベンダーで子午線方 向に湾曲して得られる擬似トロイダル形状である。 ミラーには熱負荷がかからないため、冷却機構は使 用しない。母材はシリコン単結晶、反射材はPtであ る。ミラーの寸法は長さ1000mm、幅100mm、厚さ 50mm、サジタル曲率半径36.23mmである。

BL40XUでは、ヘリカルアンジュレータ光を単色 化せず直接ミラーで受け、二次元集光をおこなう。 集光は2枚のミラーをKirkpatric-Baez配置にし、鉛 直・水平方向を独立に集光する。両ミラーの形状は 平面母材をベンダーにより湾曲して得られる円筒面 形状である。ミラーには最大100W程度の熱負荷が かかるため、間接水冷却機構が側面に取り付けられ る。母材には熱特性の優れたシリコン単結晶を用い る。反射材はRhである。ミラーの寸法は、水平集 光ミラーが長さ700mm、幅70mm、厚さ30mm、鉛 直集光ミラーが長さ400mm、幅50mm、厚さ30mm である。

ミラーベンダーは、偏向電磁石ビームラインで使用されているものと設計原理が同じSPring-8標準の クランプ回転型湾曲機構である。

現在、両ビームラインのミラー本体及び湾曲機構 の製作が順調に進められている。

### 2-5.制御・インターロック

BL35XUおよびBL40XUにおける制御システム は、これまでに蓄積したノウハウを基に、既存の制 御システムをそのまま導入する予定である。ただし、 ビームラインの構成が複雑なBL35XUのインターロ ックシステムに関しては、幾つかの特殊な点がある ため、以下にBL35XUにおけるビームラインインタ ーロックの概要を示す。

BL35XUは、一つの光学ハッチと四つの実験ハッ チにより構成され4種類の実験モードが想定されて いる。これらの実験モードは、3種類の分光器によ リ分岐する4種類の光路に対応している。図7は各ハ ッチのレイアウトと放射光の光路(から)につ いての模式図である。実験モード、すなわち、この 光路の切り替えによって、放射線防護から規定され る実験ハッチのインターロック動作は大きく変化す る。特に、1と3の光路については、一度実験ハッチ を通り抜けた放射光が再度戻ってくることから、2 台のエンドストッパ(ES)、3台の下流シャッタ (DSS)の動作条件、および、実験ハッチの開閉状 態について、これまでにない複雑なインターロック 動作が必要となる。現在、これらのインターロック 動作の詳細を策定中である。

3.実験ステーション

3-1. 高エネルギー分解能非弾性散乱ビームライン BL35XU

BL35XUはこれまでの標準的なビームラインと比 べ、ビームライン光学系と実験ステーションに関し てより一体となって考慮しなければならず、全体設 計にはひときわ努力がなされたビームラインであ る。このビームラインでは高エネルギー分解能非弾 性散乱(IXS)および核共鳴散乱(NRS)の二つの 手法を用いて物質の動的解析がおこなわれる。この 実験目的を達成するには、とりわけ、~meVすな わち結晶によるエネルギー分解能 E/E<10<sup>-7</sup>によ る非弾性散乱実験をおこなうためには、ビームライ

> ン全体設計に影響を及ぼ すような少々複雑な光学 系が必要になる。詳細に ついては本稿の他参考文 献<sup>[7]</sup>を参照されたい。

非弾性散乱のスペクト ロメーターにはBragg角 が90°近い背面反射配置 がしばしば用いられる が、このためにビームラ

Backscattering Hutch

Backscattering

Monochromator





Hutch Layout for BL35XU



イン全体が大きなものにならざるを得ない。なぜな らば、この幾何学配置は分光器や結晶アナライザに おいてエネルギー分解能を落とさずに大きな角度の アクセプタンスをもたらすが、入射光と反射光を空 間的に分離するために距離を大きくする必要がある からである。さらに、ここで必要とされる程度に高 いエネルギー分解能を得るために選ばれるシリコン の高次反射は比較的反射率が低く、また、高精度な 温度制御を必要とするため、できれば一回反射の分 光器が望ましいわけである。このため、高エネルギ ー分解能の分光系としての最初のコンポーネントで ある背面反射分光器は可能な限り光源から遠ざける 必要がある。実際には蓄積リング棟の実験ホール内 で収まるぎりぎりの距離として83m程度となってい る。背面反射分光器は常温付近にてmKのオーダー で精密に制御する必要があり、現在SPring-8インハ ウスにて開発が進められている。

背面反射後のビームは入射ビームの真上を通り光 学系により適当な高低差(370mm)がつけられた 後、試料位置に導かれる(図8下側参照)。試料位置 は背面反射分光器から19m戻ったところに位置す る。この距離を確保し、この間で平行配置のSi 111 非対称反射を用いることにより往きのビームと試料 への帰りのビームに十分な高低差を与えることが可 能になる。また、途中には9:1集光となるように設 計されたミラーが挿入され必要に応じて150×150m<sup>2</sup> (FWHM)までビームサイズを絞ることができる。 ミラーによる反射ビームについては最大6mradまで 上向きに偏向される。このため、実験ハッチ4内の 帰りのビームダクトは傾斜架台上にて角度を変える ことが可能で、場合によりミラーを軸から外し、水 平にビームを導くことも可能である。

試料そのものは低温領域で温度制御するためHe 循環式クライオスタットに取りつけられ、十分な大 きさを有するEulerian Cradle (Huber 512.1)上に 搭載される。場合によってはEulerian Cradleを取 り外し、別途高圧セル等の重量200kg、直径 500mmまでの重量物を搭載することも可能である。

スペクトロメーターは二つの独立したアナライザ ーアームを有する(いずれもHuber社製)。一方は 散乱面が垂直な、すなわちアームが縦方向に動くも ので、4~10meV程度の比較的高いmomentum transferの測定に用いられる。もう一方のアームは 10m長のもので散乱面が水平、すなわち水平方向に 動くものである。これによりエネルギー分解能~ meV、10 <sup>1</sup>以下の小さなmomentum transferの 測定が可能になる。結晶アナライザーの方向を正し く保持するためには縦方向のアームにおいて約 30µrad、水平方向のアームにて15µradの極めて厳 しい精度での動きが要求される。背面反射結晶アナ ライザーそのものはおそらく、このビームラインで 最も難しいコンポーネントとなる。要求されるエネ ルギー分解能の点で、単に結晶をベントする方法は 用いることができず、大きさ0.7×0.7×3mm<sup>3</sup>のシリ コン完全結晶の小片10000個以上を球面状に磨かれ た基板上に貼り付けることにより製作される。結晶 アナライザーはNECにより製作される予定で、現 在、SPring-8と製作方法や性能の最適化に関して共 同開発が進められている。

一方、核共鳴散乱実験は上流の実験ハッチ1、2に おいておこなわれる。実験ハッチ1(NRS-1)にお いて高エネルギー分解能分光器が組まれ、試料は実 験ハッチ2(NRS-2)に置かれる。ハッチを分離す ることにより分光器の温度を安定に保ったまま試 料、測定器のセットアップ等ハッチへのアクセスが 可能になる。また、コリメーター、集光レンズ、偏 光子等の付加的な光学系が光学ハッチ内の予備スペ ースに挿入されることもある。検出器としてはいく つかの種類のアバランシェフォトダイオードを用い る予定である。

最後にこのビームラインにおける付加的な使用形 態について簡単に述べる。上記集光ミラーを光軸か らはずし、ミラーと試料間の真空ダクトを傾斜架台 により水平に戻すことにより、非集光で発散の小さ なビームを用いることが可能である。これにより小 さなqの領域において分解能の高い測定が可能にな る。また、実験ハッチ2(NRS-2)から実験ハッチ 4(IXS)の試料位置に向けて直接ビームを導入す ることも可能なように輸送系、インターロックが構 成されており、測定に使用するエネルギーなどの自 由度を広げることができる。

#### 3-2. 高輝度ビームラインBL40XU

このビームラインは、生体高分子(非結晶、世話 人 大阪大学 猪子洋二氏)から構造生物学研究用 小角散乱ビームラインとして提案されたものだが、 ビームライン検討委員会では構造生物学研究用にこ だわらず汎用性を持たせて建設するようコメント付 きで答申された。したがって実験ステーションも汎 用性を持たせるために、基本は上面に何も固定しな い長さ3m、幅1mの実験架台からなる。その上流に 高速(10us程度)と中速(1ms程度)の2つのシャ ッターとアブソーバ、スリットを設置する架台を置 く。実験架台には、小角散乱実験用としてX、Zス テージに乗った試料ステージと長さ約2.5mの真空 パスを設置できるようにする。これらは軽量に設計 し、容易に組み立て解体が可能なように配慮してい る。X線検出器としては、毎秒5000フレーム程度の 高速CCDカメラ(低残光性蛍光体を使用したX線イ メージインテンシファイア付き)を準備する。また、 高速シャッターとイメージングプレートの組み合わ せも重要な検出器となるであろう。さらに反応の励 起用にYAGレーザーを設置する予定であるが、安 全設備の問題があるため設置はビームライン完成後 となる。実験ステーション機器の概要について図9 に示す。

4.おわりに

これら2本のビームラインは、先の偏向電磁石ビ ームラインに並行して、もしくは、ほぼ連続的につ ながる格好で整備が進められている状況にあり、今 秋以降には試験調整運転がはじめられる見通しであ る。

最後に、ビームライン建設に関して各方面にてご 尽力を頂いた原研、理研、財団の事務の皆様、多田 室長をはじめとする安全管理室の皆様に感謝しま す。 参考文献

- [1]石川哲也: SPring-8利用者情報Vol. 3, No. 5, 7-10 (1998)
- [2]後藤俊治他:SPring-8利用者情報Vol. 4, No. 3, 53-64 (1999)
- [3] T. Ohata et al. : J. Synchrotron Rad, 5, 590 -592 (1998)
- [4] 原 徹他: SPring-8利用者情報Vol. 1, No. 3, 19-23 (1996)
- [5] T. Hara et al : J. Synchrotron Rad, **5**, 403 405 (1998)
- [6] T. Koda: 私信
- [7] A.Q.R. Baron, Y. Tanaka, S. Goto, K. Takeshita, T. Matsushita and T. Ishikawa: "An X-Ray Scattering Beamline for Studying Dynamics", J. Phys. & Chem. Solids, Accepted for Publication, (1999) Also available from the authors (please send e-mail to baron@ spring8.or.jp)

<u>後藤 俊治 GOTO Shunji</u>

 (財高輝度光科学研究センター 放射光研究所 ビームライン部門 〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL:0791-58-0831 FAX:0791-58-0830
e-mail:sgoto@spring8.or.jp



図9 BL40XUの実験ステーション機器